

ALT, 光 MEMS スキャナ計測システムの販売に注力

—マイクロプロジェクタやレーザプリンタ分野などの検査ニーズに対応—

レーザライン光源や各種検査・計測システムを手掛けるエーエルティー（ALT）は、光MEMS スキャナ計測システム「ALT-9A44」を開発し、販売展開を行なっている。

ALT-9A44は光MEMS スキャナの光学・電気特性を測定するもので、ウォブルやジッタ、共振周波数、外乱によるドリフトといった測定も可能としている。また、独自開発の新時間計測方式を採用しており、最大振り角を短時間で計測することも可能にした。これにより、研究開発用途だけではなく、量産にも対応するとしている。

光MEMS スキャナは光スイッチやアッテネータに代表される通信分野やレーザプリンタなどで応用されているほか、最近ではレーザを光源としたマイクロプロジェクタ、ヘッドアップディスプレイなどといったアプリケーションでの適用が進んでいる。

同社は、これまでOA機器分野におけるレーザプリンタ用スキャナ検査システムの開発を手掛け、販売実績を高めてきた。レーザプリンタ向けではポリゴンスキャナやLSU、ポリゴンミラー、 $f\theta$ レンズ、コリメータ調整など、各種専用の検査システムを製品化しているが、そこで培った技術を光MEMS スキャナ計測システム開発に展開し、新たな事業の柱に加えた。

「ALT-9A44は国内を中心に累計25システム以上を納入している。レーザプリンタ用を含めると100システム以上」（同社）という。価格は450万円で、最近では温度や圧力といった耐環境、耐久試験などの測定ニーズが高まっているという。

こうした検査に対応するため、真空での測定を可能にする特殊小型チャンバーや簡易パーンユニット、デジタ

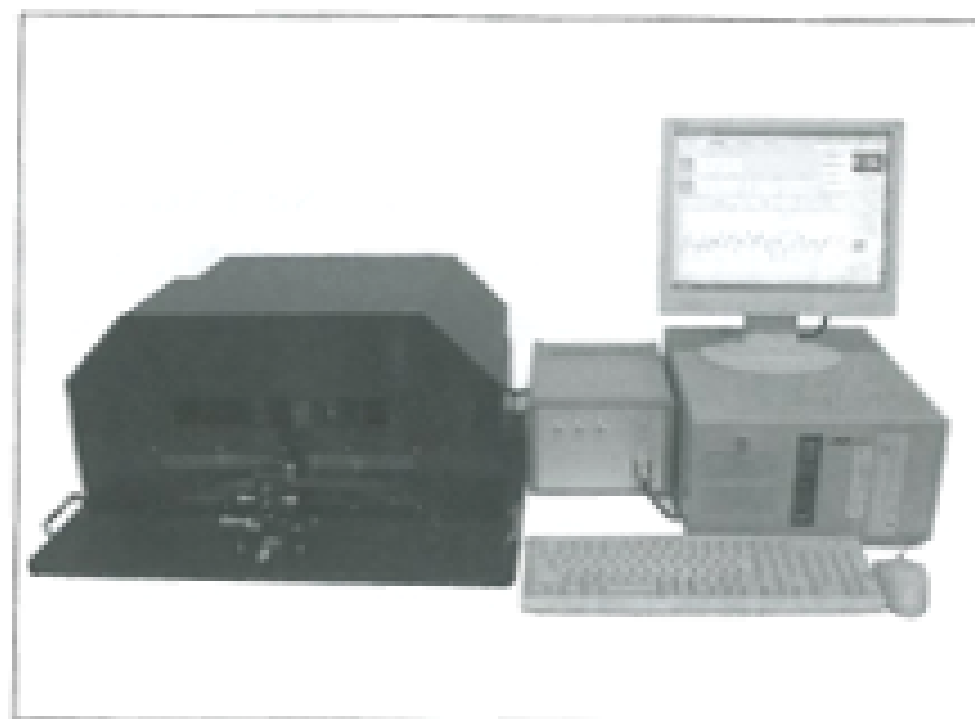


写真 光MEMS スキャナ計測システム

ル周波数発生モジュール、2次元高速度PSDセンサといった拡張システムもラインナップしている。

また、ジッタによる走査ムラを計測するための16CH TIA（タイム・インターバル・アナライザ）も新たに開発。従来4チャンネルタイプが主流だったが、このユニットでは分解能81 ps、内部ジッタ300 psの高精度で入力を16チャンネル（最大22 ch）と多チャンネル化し、任意に選択されたインターバル時間の測定を可能にした。インターフェースはUSBを使用しているため、光ディスク、レーザプリンタ、通信などにおけるジッタ計測の測定システムを容易に構成できるという。価格は150万円で、昨年夏から出荷を開始した。

「現在、国内で光MEMS 応用製品の实用開発に取り組んでいる企業はおよそ20社あり、今後こうした企業への販売展開に注力したい」（同社）としている。マイクロプロジェクタなど光MEMS スキャンを応用した製品の登場が期待される中、同社ではこうした製品に対応する新たな検査システムの開発を進めていく方針だ。